

走査型ケルビンプローブシステム

特長

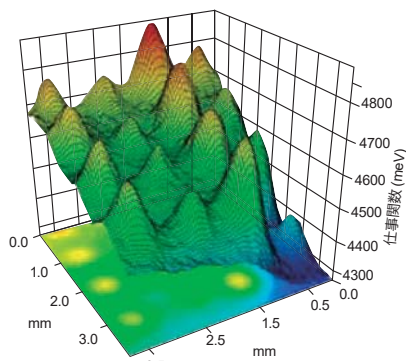
- 高い仕事関数分解能：< 3 meV
- Off-Null(Baikie)法により、安定した高s/n比・再現性・高分解能
- 走査ステージによるイメージング機能(点測定モデルもあり)
- 大気中で簡単に測定

仕様

型名	SKP5050	ASKP100100	ASKP200250	ASKP350350
チップ材料 / 直径	金 / 2 mm			
仕事関数分解能	< 3 meV			
最大走査領域 (mm)	50×50	100×100	200×250	300×300
走査パターン	矩形	矩形	矩形	矩形・円形
付属品	観察用カメラ、小型モニター、オシロスコープ、静電シールドカバー			

オプション

- ・表面光起電力測定用光源 (石英タングステンハロゲン光源/LED)
- ・表面光起電力測定用波長可変光源 (400~1000 nm)



微小凹凸層で修飾されたSi基板

【製品の詳細情報へ】



走査型ケルビンプローブシステム

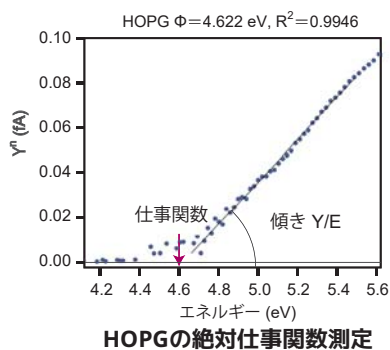
有機EL電子状態評価システム

特長

- 光電子収量分光法 (PYS)による仕事関数の絶対値測定
- エネルギー範囲: 3.4 eV ~ 7.0 eV (176~360 nm)
- ケルビンプローブ法による相対仕事関数の測定も可能
- 大気中・非接触測定

仕様

型名	APS01	APS02	APS03	APS04
3軸走査型ケルビンプローブ機能	—	○	○	○
表面光起電力測定用光源	—	—	○	○
表面光起電力測定用波長可変光源	—	—	—	○
チップ材料 / 直径	金 / 2 mm			
仕事関数分解能	50 meV (< 3 meV/ケルビンプローブモード)			
付属品	観察用カメラ、小型モニター、オシロスコープ、静電シールドカバー			



HOPGの絶対仕事関数測定

【製品の詳細情報へ】



有機EL電子状態評価システム

上記2製品の主な用途

太陽電池材料の評価 / イオン化ポテンシャルの測定 / 薄膜の膜質評価 / 有機EL材料の評価 / 金属の浸食・腐食分析

金属表面の水分吸着をリアルタイム観察
腐食、形状変化の高感度検出

環境制御型・高感度 表面電位マッピング装置



RHC020



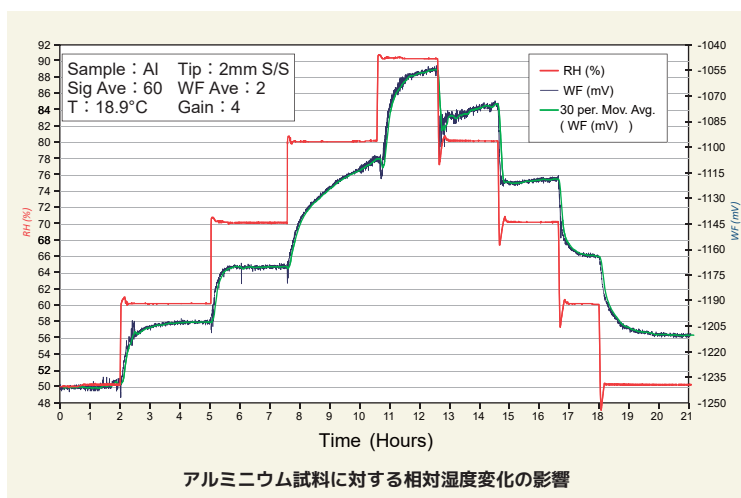
RHC040

特長

- 表面状態の高感度モニタリング
— 形状・吸着・改質・腐食など —
- 非破壊、非接触測定
- 環境制御した *In Situ* 測定
- 湿度、温度、酸素濃度を制御
- 簡単測定

主な仕様

型名	RHC020	RHC040
チップ直径	2 mm	
仕事関数分解能	< 3 meV	
走査領域 (mm)	50×50	
相対湿度制御 (25~80%)	○	○
雰囲気制御 (酸素 < 1%)	—	○
オプション	加熱ステージ(室温~100℃/250℃)	



KP Technology 社について

KP Technology社は、2000年創業の会社で、走査型ケルビンプローブシステムや有機EL電子状態評価システムなどの仕事関数測定装置の専門メーカーです。これまで、300システム以上の装置を大学、研究所、民間企業に納入しています。創業者でありCEOでもあるProf. Iain D. Baikielは、1980年代から表面分析のためのケルビンプローブシステムの開発に携わり、この分野の開発と応用で、30年以上の経験を持っています。

TII 株式会社 東京インスツルメンツ
TOKYO INSTRUMENTS, INC.
Mutual Satisfaction

本社：〒134-0088 東京都江戸川区西葛西 6-18-14 T.I.ビル
大阪営業所：〒532-0003 大阪市淀川区宮原 4-1-46 新大阪北ビル

TEL: 03-3686-4711
TEL: 06-6393-7411

FAX: 03-3686-0831
FAX: 06-6393-7055

URL <http://www.tokyoinst.co.jp/>

- 本カタログに記載されている内容は、改良のため予告無く変更する場合があります。
(製品の仕様、性能、価格等はカタログ発行当時のものです)
- 本カタログに記載されている内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されております。
- 本カタログに記載されているメーカー名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

【製品の詳細情報へ】



環境制御型・高感度
表面電位マッピング装置